2026年11月６日

各　　位

会 社 名：ウインテスト株式会社
（コード：6721 東証スタンダード市場）
代表者名：代表取締役　　姜　　輝
問合せ先：管理本部長　　鎌田　文明
（ＴＥＬ：045-317-7888）

第13回新株予約権による資金使途及び支出予定時期の変更に関するお知らせ

当社は、2026年11月６日開催の取締役会において、第13回新株予約権による具体的な使途及び支出予定時期を変更する決議をいたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．変更の理由

当社は、2025年12月26日付「第三者割当による第13回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に関するお知らせ」及び2026年６月25日付「資金使途支出予定時期の変更に関するお知らせ」にて公表いたしました、調達する資金の具体的な使途につきまして、半導体前工程検査装置事業の立上げに必要な設備投資、専門技術者の採用・育成、新規事業の販売促進活動および運転資金等への充当を計画しておりました。しかしながら、当社の主力事業である民生・産業用半導体向け検査装置市場においては、AI関連半導体への設備投資集中が継続する一方、民生・産業用半導体分野の設備投資回復は当初の想定より緩やかに推移しております。

第13回新株予約権については、発行後の株価推移に伴い、総調達額が当初の想定を下回る結果となりました。この結果、最終的な調達額は、584百万円（差引手取額:576百万円）となり、当初の払込費用の総額733百万円（差引手取概算額：724百万円）に対して、約２割程度減少することとなりました。

また、半導体前工程検査装置事業の立上げに向けて大阪事業所で進めているクリーンルーム建設についても、中東地域における地政学的緊張や物流環境の変化等の影響により、一部工事関連部材の調達に遅れが生じております。このような状況を踏まえ、当社では、事業の立上げに必要な機能および品質を確保しながら、限られた資金をより効率的に活用するため、当初の設備投資計画および資金配分について見直しを進めてまいりました。

その結果、当社が既に保有するクリーンルーム設備および関連設備を可能な限り再利用するとともに、新規設備の導入範囲や工事内容を最適化することで、初期設備投資額の削減を図り、調達資金の減少に対応する方針といたしました。なお、今回の見直しは、半導体前工程検査装置事業の縮小や後ろ倒しを目的とするものではありません。当社では、既に一部製造エンジニアの教育・育成を継続するとともに、海外大手顧客における現場での実機評価や、2026年10月15日に当社WEBサイト「半導

体前工程検査装置事業の進捗に関するお知らせ」にてお知らせしましたように、大手半導体関連企業との秘密保持契約（NDA）締結に至るなど、積極的に顧客開拓活動を進めております。

当社は、こうした事業進捗および今後の市場展開の可能性を踏まえ、前工程検査装置事業を引き続き重要な成長分野の一つと位置付けております。今回の変更は、設備投資の効率化と資金配分の最適化を通じて、事業の立上げを着実に進めるとともに、将来的な事業拡大に向けた経営基盤を整備することを目的とするものであります。

以上の理由により、第13回新株予約権による具体的な使途および支出予定時期を変更するものであります。

２．変更の内容

資金使途の変更の内容は以下のとおりであります。（変更箇所は下線で示しております。）

特に今回の変更は、「新規「前工程装置事業」立上げに関わる準備費用」のなかで予定していましたクリーンルームの建設終了後に、新たに拡張の必要性が生まれ、拡張に伴う工事を行うものです。拡張の必要性の詳細につきましては、下記、「３．既存クリーンルームの整備・拡張について」をご参照下さい。

(変更前) 2026年6月25日公表　「資金使途支出予定時期の変更に関するお知らせ」

具体的な使途	金額(千円)	支出予定時期
①新規「前工程装置事業」立上げに関わる準備費用	256,000	2026年1月～2027年3月
②専門技術者、サポート要員の採用と教育、育成	50,000	2026年1月～2026年12月
③開発中の新規3事業関連プロモーション費用及び量産に関わる費用	50,000	2026年1月～2026年12月
④その他運転資金	368,747	2026年1月～2026年12月
計	724,747	

(変更後)

具体的な使途	金額(千円)	支出予定時期
①　新規「前工程装置事業」立上げに関わる準備費用	120,248	2026年1月～2027年3月
②専門技術者、サポート要員の採用と教育、育成	29,391	2026年1月～2027年1月
③開発中の新規3事業関連プロモーション費用及び量産に関わる費用	42,834	2026年1月～2026年12月
④その他運転資金	379,628	2026年1月～2026年11月
⑤(新規)上記①、クリーンルームへの追加拡張工事	4,000	2026年11月～2026年12月
計(差引手取額)	576,102	

※ 差引手取額は、584,522 千円から発行諸費用の額 8,420 千円を差し引いた 576,102 千円となります。

３．新設したクリーンルームの整備・拡張について

当社は、2025 年 12 月 26 日付「新事業『半導体の前工程検査装置事業』開始に関するお知らせ」において公表いたしましたとおり、半導体前工程検査装置事業への新規参入に向け、同日付「第三者割当による第 13 回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に関するお知らせ」に基づく調達資金の一部を活用し、大阪事業所におけるクリーンルームの新設及び製造体制の構築を進めてまいりました。

工事期間中には、中東情勢等の影響による一部工事関連部材の調達遅延や、新株予約権の行使に伴う資金調達の進捗が当初想定を下回るなどの懸念もありましたが、半導体前工程検査装置事業の立上げへの影響を最小限に抑えるため、新設で建設したクリーンルーム内の設備構成の見直しや既存クリーンルーム設備の一部活用等による効率化を図り、付帯設備として予定していた 20 百万円につきましては削減ができました。その結果、当初工期に関して計画時期を変更することなく、2026 年６月末までに大阪事業所におけるクリーンルームの新設を完了し、同年７月初旬には必要な周辺機材の搬入を進めるなど、前工程検査装置の組立・調整等に必要な作業環境を確保いたしました。重ねて、以下に経緯詳細を詳述いたします。

４月から工事を進めるにつれ中東情勢の問題により工事部材、加えて水関連工事部材などが一切入ってこなくなり、工期が大幅に遅れる懸念から、一部のクリーン空調設備、湿度調整設備などを旧クリーンルーム（ROM 書込み室）の物を流用することとし、工期が遅れない施策を取ってまいりました、加えてクリーンルーム機能には直接関係ない化粧塗装など周辺部工事を取りやめた結果、費用も時間も削減でき 108.8 百万円の緊縮費用で完成いたしました。なお、付帯設備に関しましては上述の通りです。評価機 1 号機は無事完成出荷したものの、新規「前工程装置事業立上げ完了」までは、今少しの追加作業が必要であり、残りの約 15 百万円は 2026 年末～2027 年 3 月にかけて今後クリーンルームに入れる製造効率を上げるための環境費用に充てる計画です。次に⑤で新たに施工するクリーンルームの追加拡張工事が必要となる理由を説明いたします。

2026 年 10 月 20 日をもって第 13 回新株予約権のすべての行使が完了したものの、実際の調達金額が当初の想定を下回ったことから、半導体前工程検査装置事業の立上げに係る準備費用や支出予定時期等について見直しを行なった経緯です。

こうした中、2026 年 10 月 15 日付で当社ウェブサイトに掲載いたしましたとおり、海外の大手半導体関連企業との間で、当社装置の導入に向けた協議を開始し、秘密保持契約（NDA）を締結いたしました。本件は、当初の事業計画では想定していなかった新たな引合いであり、今後の事業展開及び製造体制の検討において重要な案件と位置付けております。なお、本件の詳細につきましては、下記４．に記載しております。また、同年 10 月 13 日付で開示いたしました「シリコンキャパシター向けウエハ検査装置『WTS-513SC』の開発完了及び販売開始のお知らせ」のとおり、新領域であるシリコンキャパシター向けウエハ検査装置事業についても、今後の事業展開に伴い、クリーンルーム設備を使用する機会の増加が見込まれます。

これらの新規案件への対応及び複数事業における設備利用の可能性に加え、2027 年以降の事業展開及び想定される事業規模を総合的に勘案した結果、当社は、新設で建設したクリーンルームの機能を維持しつつ、今後の製造・評価能力をさらに増強する必要があると判断いたしました。このため、本日開催の取締役会において、2026 年 12 月末までに新設クリーンルームと既存クリーンルームの一体化を可能とする追加拡張工事を実施することを決議いたしました。

４．今後の見通しと影響

本件による 2026 年 12 月期の連結業績への影響は軽微であります。なお、半導体前工程検査装置事業につきましては、2027 年３月以降の本格的な事業展開を予定しており、今後、開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以上